

オープンファシリティセンター バイオユニット 登録設備一覧

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
1	ハイスピード 蛍光イメージングシステム	ライマインシステムズ 社	AF6500	井沢真吾	井沢真吾	thioredoxin@kit.ac.jp	2号館	3	350	1,100 /時間
2	リアルタイムPCR装置	BioRad	CFX96	吉田英樹	吉田英樹	hyoshida@kit.ac.jp	2号館	2	232	700 /時間
3	DNAシーケンサー	ABS	3500Genetix Analyzer	加藤容子	加藤容子	ykato@kit.ac.jp	2号館	2	232	9,000 /回
4	共焦点レーザー走査型顕微鏡 FV10i	オリンパス	FV10i	吉田英樹	吉田英樹	hyoshida@kit.ac.jp	2号館	2	232	1,500 /時間
5	細胞観察用共焦点レーザー顕微鏡	オリンパス	FV1000	小谷英治	小谷英治	kotani@kit.ac.jp	2号館	3	336	3,200 /時間
6	二酸化炭素同位体比アナライザ	Picarro	G2101-i	半場祐子	半場祐子	hanba@kit.ac.jp	2号館	4	436	1,400 /時間
7	分析走査電子顕微鏡 MegaView G2	日本電子	JSM-6519A MegaView G2	吉村亮一	吉村亮一	ryoshimu@kit.ac.jp	2号館	5	533	2,400 /時間
8	超遠心機	日立工機	CP80WX	志波智生	志波智生	tshiba@kit.ac.jp	2号館	3	333	1,400 /時間
9	液体クロマトグラフィーシステム	Citiva	AKTA pure	志波智生	志波智生	tshiba@kit.ac.jp	2号館	3	333	1,200 /時間
10	クイックカーボンコーター	サンユー電子	SC-701C	吉村亮一	吉村亮一	ryoshimu@kit.ac.jp	2号館	5	533	300 /時間
11	クイックオートコーター	サンユー電子	SC-701AT	吉村亮一	吉村亮一	ryoshimu@kit.ac.jp	2号館	5	533	300 /時間
12	ウルトラマイクロトーム	LEICA	ULTRACUT R	吉村亮一	吉村亮一	ryoshimu@kit.ac.jp	2号館	5	533	600 /時間
13	共焦点顕微鏡 FV4000	エビデント	FV4000	吉田英樹	吉田英樹	hyoshida@kit.ac.jp	2号館	2	232	3,900 /時間
14	蛍光顕微鏡	オリンパス	IX83	井沢真吾	井沢真吾	thioredoxin@kit.ac.jp	2号館	2	232	1,000 /時間
15	小型超純水製造装置	メルク	milli-Q SQ240C	バイオユニット長	バイオユニット長	hyoshida@kit.ac.jp	2号館	2	232	3,000 /L
16	全自動製氷機	ホシザキ	FM-12F	バイオユニット長	バイオユニット長	hyoshida@kit.ac.jp	2号館	3	335	1,000 /kg
17	フレークアイスメーカー	ホシザキ	FM-120K-50	バイオユニット長	バイオユニット長	hyoshida@kit.ac.jp	2号館	2	232	1,000 /kg
18	フレークアイスメーカー	ホシザキ	FM-120M-50	バイオユニット長	バイオユニット長	hyoshida@kit.ac.jp	2号館	2	232	1,000 /kg

オープンファシリティセンター 機器分析ユニット 登録設備一覧

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
1	核磁気共鳴装置 (NMR) 600MHz	Bruker	Bruker600MHz	金折	金折 賢二	kanaori@kit.ac.jp	1号館	地下1階	011室 (磁気共鳴実験室)	12,600 / 時間
2	核磁気共鳴装置 (NMR) 400MHz	Agilent	Agilent400MHz	金折	金折 賢二	kanaori@kit.ac.jp	2号館	1階	N107室 (核磁気共鳴室)	6,200 / 時間
3	核磁気共鳴装置 (NMR) 300MHz	Bruker	Bruker300MHz	金折	金折 賢二	kanaori@kit.ac.jp	2号館	1階	N107室 (核磁気共鳴室)	4,900 / 時間
4	示差走査熱量計 (DSC) DSC2920	TA Instruments	DSC2920	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	13号館	1階	105室 (分析機器室1)	2,100 / 時間
5	熱重量測定装置 (TGA) Discovery TGA	TA Instruments	TA-Discovery	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	13号館	1階	105室 (分析機器室1)	2,500 / 時間
6	円二色性分散計 (CD)	JASCO	J-720	和久	和久 友則	waku1214@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	3,500 / 時間
7	X線光電子分光装置 (XPS)	JEOL	JPS-9010	Marin	ELIA MARIN	elia-marin@kit.ac.jp	13号館	1階	105室 (分析機器室1)	8,000 / 時間
8	X線回折装置 (XRD) MiniFlex600	Rigaku	MiniFlex600	細川	細川 三郎	hosokawa@kit.ac.jp	13号館	1階	106室 (X線装置室)	800 / 時間
9	X線回折装置 (XRD) Ultima IV	Rigaku	Ultima IV	細川	細川 三郎	hosokawa@kit.ac.jp	13号館	1階	106室 (X線装置室)	2,100 / 時間
10	走査型電子顕微鏡 (SEM) JSM-5600	JEOL	JSM-5600	西川	西川 幸宏	kiro@kit.ac.jp	13号館	2階	202D室 (分析機器室3)	200 / 時間
11	*走査型電子顕微鏡 (SEM) JSM-7600F	JEOL	JSM-7600F	足立	足立 馨, 本柳 仁	kadachi@kit.ac.jp	13号館	2階	202D室 (分析機器室3)	5,000 / 時間
12	エバネッセント顕微鏡 (TIRF)	NIKON	TE-2000-e	和久	和久 友則	waku1214@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	1,600 / 時間
13	偏光顕微鏡 (PM)	NIKON	E600 POL	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	200 / 時間
14	共焦点レーザー顕微鏡 (CLSM)	KEYENCE	VK-X200	朱	朱 文亮	wlzhu@kit.ac.jp	13号館	2階	202D室 (分析機器室3)	1,700 / 時間
15	光電子収量分光装置 (PYS)	分光計器	BIP-KV202GTGK	木梨	木梨 憲司	kinashi@kit.ac.jp	13号館	1階	105室 (分析機器室1)	4,900 / 時間
16	動的粘弾性測定装置 (DMA) DMA7100	日立ハイテクサイ エンス	DMA7100	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	1,300 / 時間
17	回転型レオメーター (RR)	TA Instruments	AR1000	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	16号館	1階	105室 (分析機器室1)	1,100 / 時間
18	ダイナミック超微小硬度計 (DUH)	島津製作所	DUH-211	坂井	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	13号館	1階	105室 (分析機器室1)	1,400 / 時間
19	熱機械分析装置 (TMA) TMA-7100	日立ハイテクサイ エンス	TMA7100	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	1,300 / 時間

オープンファシリティセンター 機器分析ユニット 登録設備一覧

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
20	示差熱-熱重量同時測定装置 (TG-DTA)	日立ハイテクサイ エンス	NEXTA STA200RV	中	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	2階	208室 (実験室)	1,500 / 時間
21	走査型プローブ顕微鏡 (SPM) SPM-9700	島津製作所	SPM-9700	岡田	岡田 有史	aokada@kit.ac.jp	13号館	2階	202D室 (分析機器室3)	2,600 / 時間
22	時間領域核磁気共鳴装置 (TD- NMR)	Bruker	MQ20	三宅	三宅 祐輔	ymiyake@kit.ac.jp	2号館	1階	N107室 (核磁気共鳴室)	2,100 / 時間
23	常磁性種解析システム (ESR) JES-X310	日本電子	JES-X310	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	1号館	地下1階	011室 (磁気共鳴実験室)	4,000 / 時間
24	動的粘弾性測定装置 Rheosol-G1000	ユービーエム	Rheosol-G1000	足立	足立 馨	kadachi@kit.ac.jp	16号館	2階	208室 (実験室)	1,200 / 時間
25	透過型電子顕微鏡 (TEM) JEM-2010	JEOL	JEM-2010/SP	西尾	西尾 弘司	knishio@kit.ac.jp	12号館	1階	112B室	3,000 / 時間
26	精密低速切断装置 (マイクロカッター MC-201)	マルトー	MC-201	西尾	西尾 弘司	knishio@kit.ac.jp	12号館	1階	112B室	500 / 時間
27	試料打ち抜き装置 (超音波ディスクカッター Model-601)	Gatan	Model-601	西尾	西尾 弘司	knishio@kit.ac.jp	12号館	1階	112B室	500 / 時間
28	精密機械研磨装置 (プチポリッシャー)	NTT-AT	POP-111	西尾	西尾 弘司	knishio@kit.ac.jp	12号館	1階	112B室	500 / 時間
29	精密機械研磨装置 (ディンプルグラインダー Model-656)	Gatan	Model-656	西尾	西尾 弘司	knishio@kit.ac.jp	12号館	1階	112B室	500 / 時間
30	精密イオン研磨装置 (PIPS Model-691)	Gatan	PIPS Model-691	西尾	西尾 弘司	knishio@kit.ac.jp	12号館	1階	112B室	500 / 時間
31	小型2次元振動台	サンエス	SPT2D-10K-12- 3T	金尾、村本	村本 真	muramoto@kit.ac.jp	1号館	地下1階	001室	5,000 / 時間
32	万能試験機	島津製作所	UH-500kNX	金尾、村本	金尾 伊織	kanao@kit.ac.jp	1号館	地下1階	003室	5,500 / 時間

オープンファシリティセンター マテリアルユニット 登録設備一覧

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
1	核磁気共鳴装置500MHz (NMR)	Bruker	AVIII-500	楠川	楠川 隆博	kusu@kit.ac.jp	16号館	1階	FT-NMR室(110室)	8,400 /時間
2	核磁気共鳴装置400MHz (NMR)	Bruker	AVIII-400	楠川	楠川 隆博	kusu@kit.ac.jp	16号館	1階	FT-NMR室(110室)	7,200 /時間
3	卓上型ガスクロマトグラフ質量 分析計	JEOL	JMS-Q1500GC	楠川・小川	楠川 隆博	kusu@kit.ac.jp	16号館	1階	質量分析システム室(109室)	3,000 /時間
4	FT-IR分光光度計(ATR用)	JASCO	FT-IR 4600	楠川	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	1,000 /時間
5	FT-IR分光光度計(透過測定用)	JASCO	FT-IR 4600	楠川	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	3,000 /時間
6	紫外可視分光光度計	shimadzu	UV-2550	町田	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	1,000 /時間
7	蛍光光度計	JASCO	FP-6500	町田	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	1,000 /時間
										15,000 /時間
										2,000 /時間
8	ゼータ電位・粒径測定システム	Otsuka Electronics	ELSZ-1000	中・井本・ 楠川	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	5,000 /時間
9	卓上型分光エリブソメータ	Otsuka Electronics	FE-5000S	中・松川・ 井本	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	2,000 /時間
10	赤外MAIRS自動分析ユニット	サーモフィッ シャーサイエン ティフィック	Nicolet6700	中・井本	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	1,000 /時間
11	ホットステージ付き偏光顕微鏡	ニコン	DS-L3	足立	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	1,000 /時間
12	熱分析装置示差走査熱量計	shimadzu	DSC-60	中・井本	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	2階	208室	1,000 /時間
13	絶対PL量子収率測定装置	Hamamatsu Photonics	Quantaurs-QY	楠川	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	5,000 /時間
14	蛍光寿命測定装置	Hamamatsu Photonics	Quantaurs-Tau	楠川	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	5,000 /時間
15	ICP発光分析装置	shimadzu	ICPE-9800	吉田	吉田 裕美	yyoshida@kit.ac.jp	12号館	5階	503A	700 /時間
16	透過電子顕微鏡 (JEM-2100)	JEOL	JEM-2100	浅岡	浅岡 定幸	sada@kit.ac.jp	2号館北棟	1階	109室	3,000 /時間
17	*質量分析装置JMS-700	JEOL	JMS-700	楠川	小川 奈津美 楠川 隆博	ogawa@kit.ac.jp kusu@kit.ac.jp	16号館	1階	質量分析システム室	3,000 /検体
18	微小部X線回折装置 (mXRD)	Rigaku	Smart Lab	楠川	楠川 隆博	kusu@kit.ac.jp	12号館	1階	114B室 (微小部X線回折室)	5,000 /時間

オープンファシリティセンター マテリアルユニット 登録設備一覧

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
19	妨害元素除去型 有機元素分析装置 (EA)	ジェイサイエンス	JM-11	楠川	吉田 綾 津田 瞳 楠川 隆博	ayoshida@kit.ac.jp tsuda@kit.ac.jp kusu@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	3,000 /検体
20	飛行時間型質量分析装置 (TOF-MS)	shimadzu	MALDI-8030	和久 楠川	西埜 誠 吉田 綾	mnishino@kit.ac.jp ayoshida@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	10,000 /時間
21	液体クロマトグラフ質量分析装置 (LC-MS)	Bruker	AmaZon SL	和久 楠川	和久 友則 楠川 隆博	kusu@kit.ac.jp waku@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	5,000 /時間
22	液体クロマトグラフ質量分析装置 (LC-MS)	shimadzu	LCMS-9030	和久 楠川	西埜 誠 吉田 綾	mnishino@kit.ac.jp ayoshida@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	10,000 /時間
23	マイクロ天秤	ザルトリウス	MC5	楠川	吉田 綾	ayoshida@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	1,000 /時間
24	カールフィッシャー水分測定装置	日東精工アナリテック	CA310	楠川	西埜 誠 吉田 綾	mnishino@kit.ac.jp ayoshida@kit.ac.jp	16号館	2階	208室	50,000 /時間

オープンファシリティセンター クリーンルームユニット 登録設備一覧

ユニット 内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
1-1	MIKASA アライナ	ミカサ	M-1S特型	山下馨	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	017	2,000 /時間
1-2	両面マスクアライナ	ユニオン光学	PEM-800	山下馨	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	017	2,500 /時間
1-3	有機ドラフト	島津製作所	CB2	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	017	3,300 /時間
1-4	電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELS-BODEN50- KIT5001	高橋駿	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	7号館	1階	102	100,000 /日
2-1	RFスパッタ装置	ULVAC	RFS-200	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	2,000 /時間
2-2	電子ビーム蒸着装置	ULVAC	VPC-1100	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	2,300 /時間
2-3	実験用熱蒸着装置	昭和真空	EA-504	蓮池	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	1,600 /時間
2-4	TEOS-CVD装置	サムコ	PD-220N	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	6,400 /時間
2-5	卓上スパッタ装置	Moorfield Nanotechnology	nanoPVD	山下兼一	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	2,000 /時間
3-1	Siディーブ エッチング装置	サムコ	RIE-400iPB	山下馨	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	20,700 /時間
3-2	化合物半導体エッチング装置	サムコ	RIE-101iPH	鐘ヶ江	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	27,500 /時間
3-3	簡易プラズマ処理装置	－ (自作のため)	－ (自作のため)	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	－ /時間
3-4	酸素プラズマ処理装置	ヤマト科学	PR200	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	1,900 /時間
4-1	酸ドラフト	ヤマト科学	CYV-180VZ	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	3,300 /時間
5-1	急速アニール炉	ULVAC-RIKO	RHL-P610CP	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	2,200 /時間
6-1	高分解能走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロ ジーズ	S-5200、S-5500	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	4,100 /時間
6-2	段差膜厚計	ブルカー	Dektak XT-S	山雄	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	2,100 /時間

オープンファシリティセンター クリーンルームユニット 登録設備一覧

ユニット 内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
6-3	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK9500	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	3,100 /時間
6-4	卓上SEM(EDX)	日立ハイテクノロ ジーズ	TM3030Plus	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	2,000 /時間
7-1	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9010MX	高橋和生	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	4,300 /時間
7-2	高精度X線回析装置	ブルカー	D8 Discover	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	4,700 /時間

オープンファシリティセンター 電波暗室ユニット 登録設備一覧

ユニット 内No.	設備	責任者	問合せ先	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)																				
1	放射エミッション(30MHz～ 6GHz)	上田哲也	<a href="https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/">https://www.cgi- emc.kit.ac.jp/contact/</a>	8号館	1階	105	64,800 /日																				
							34,100 /半日																				
2	放射エミッション(9kHz～ 30MHz)	上田哲也					<a href="https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/">https://www.cgi- emc.kit.ac.jp/contact/</a>	8号館	1階	105	64,800 /日																
											34,100 /半日																
3	伝導エミッション(9kHz～ 30MHz)	上田哲也									<a href="https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/">https://www.cgi- emc.kit.ac.jp/contact/</a>	8号館	1階	105	64,800 /日												
															34,100 /半日												
4	ネットワークアナライザ (10MHz～90GHz)	上田哲也													<a href="https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/">https://www.cgi- emc.kit.ac.jp/contact/</a>	8号館	1階	105	51,840 /日								
5	放射RF電磁界イミュニティ試 験(80MHz～6GHz)	上田哲也																	<a href="https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/">https://www.cgi- emc.kit.ac.jp/contact/</a>	8号館	1階	105	81,000 /日				
																							42,600 /半日				
6	伝導RF電磁界イミュニティ試 験(150kHz～230MHz)	上田哲也																					<a href="https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/">https://www.cgi- emc.kit.ac.jp/contact/</a>	8号館	1階	105	81,000 /日
																											42,600 /半日

オープンファシリティセンター ものづくりユニット 登録設備一覧

ユニット内No.	設備名	装置	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
1	精密3次元 微細加 工・評価 システム	精密微細加工機	コマツNTC	Z $\mu$ -3500	山口	鳥海至希子	monotech@kit.ac.jp	西実験棟	1	102	7,000 /時間
2		ターニングセンター	DMG森精機	NTX1000	山口	鳥海至希子	monotech@kit.ac.jp	西実験棟	1	102	5,000 /時間
3		ワイヤー放電加工機	三菱電機	NA1200	山口	鳥海至希子	monotech@kit.ac.jp	西実験棟	1	102	7,000 /時間
4		精密成型機	アマダ	SDE-8018	山口	鳥海至希子	monotech@kit.ac.jp	西実験棟	1	101A	5,000 /時間
5		3次元座標測定器	ミットヨ	CRYSTA- ApexS9106	山口	鳥海至希子	monotech@kit.ac.jp	西実験棟	1	103	5,000 /時間
6		レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-X200/X210	山口	鳥海至希子	monotech@kit.ac.jp	10号館	1	104	2,000 /時間
7	5軸制御加工システム		DMG森精機	DMU50	山口	鳥海至希子	monotech@kit.ac.jp	福知山B棟	1	108	5,000 /時間
8	Super Processing Center		コマツNTC	—	山口	鳥海至希子	monotech@kit.ac.jp	18号館	1	105	7,000 /時間
9	電子ビーム金属積層造形装置		三菱電機	EZ300	山口	鳥海至希子	monotech@kit.ac.jp	18号館	1	105	20,000 /時間
10	窒素ガスプラスト装置		不二製作所	PNEUMA BLASTER	山口	鳥海至希子	monotech@kit.ac.jp	18号館	1	105	1,500 /時間
11	アブレイシブジェット加工システム (ウォータージェット加工機)		スギノマシン	VARUNA	山口	鳥海至希子	monotech@kit.ac.jp	西実験棟	1	101A	1,000 /時間
12	その他の一般装置		—	—	山口	鳥海至希子	monotech@kit.ac.jp	西実験棟	1	101A	1,500 /時間

オープンファシリティセンター ものづくりユニット 登録設備一覧

ものづくりユニット ※一般装置内訳

9-1	汎用旋盤 (計8台)	滝澤鉄工所	TSL-550	× 3 台	9-20	ラボカッター (計2台)	マルトー	MC-122
9-2			TAL460		9-21			MC-743
9-3			TSL-800	× 2 台	9-22	シャーリングマシン	相澤鉄工所	A512
9-4			TSL-800 (旧式)	× 2 台	9-23	ハンド式シャーリングベンダー	CGK	BG-20HS
9-5	汎用フライス盤 (計5台)	日立ピアエンジニアリング	2 MW-V		9-24	レーザー加工機	三菱電機	806T3
9-6		豊田工機	Z1C-1		9-25	TIG溶接機	ダイヘン	AVP-300
9-7		井上工機	IV-1		9-26	CO2溶接機	ダイヘン	DM350
9-8		イワシタ	NK-1		9-27	スポット溶接機	ダイヘン	SLAJ-601
9-9		静岡鉄工所	SV-W II		9-28	シャープレスブレーキ	ベルメックス	—
	マシニングセンタ	DMG森精機	NVX5080/40		9-29	円筒研削盤	トヨタ	GOP10-30
9-10	マシニングセンタ	DMG森精機	F-m1		9-30	タレットパンチ	ムラテック	MOTORUM-2044EZ
9-11	ボール盤 (計8台)	紀和鉄工所	KUD-550FP		9-31	倣(ならい)放電加工機	CHARMILLES	P25
9-12		キラ・コーポレーション	NSD-13R	× 2 台				
9-13		遠州工業	ESD-350SL	× 5 台				
9-14	バンドソー	アマダ	H-250SA					
9-15	弓鋸盤 (計2台)	村橋製作所	—	× 2 台				
9-16	コンターマシン	日本工機	SE-500					
9-17	平面研削盤	長瀬鉄工所	SGM-63					
9-18	両頭グラインダー	淀川電機製作所	FG255T					
9-19	ベルトサンダー	下村電友舎製作所	SRS-044					

オープンファシリティセンター デザインファクトリーユニット 登録設備一覧

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
1	Wood / Metal Factory			津田	津田 和俊	dfactory@kit.ac.jp	デザインファクトリー		10,000 /時間
2	Digital Factory			津田	津田 和俊			10,000 /時間	
3	Textile Factory			津田	津田 和俊			10,000 /時間	
4	Bio-Material Factory			津田	津田 和俊			10,000 /時間	
5	3D Scanning System			津田	津田 和俊			10,000 /時間	
6	Robot Arm			津田	津田 和俊			10,000 /時間	
7	MEX 3D Printer			津田	津田 和俊			10,000 /時間	

材料費

(1) 高精細3Dプリンター (Digital Factory)

区分	材料費等 (円/1g)
モデル材	¥115
サポート材	¥66

(5) 昇華顔料テキスタイルプリンタ (Textile Factory)

区分	材料費等 (円/1,000mm)
インク	¥1,100

(2) 大型FDM 3Dプリンター (Digital Factory)

区分	材料費等 (円/1g)
モデル材	¥10

(6) 粉末焼結3Dプリンター (Digital Factory)

区分	材料費等 (円/1グラム)
材料	¥30

(3) 光造形3Dプリンター (Digital Factory)

区分	材料費等 (円/1ml)
モデル材	¥50

(7) UVプリンター (Digital Factory)

区分	材料費等 (円/回)
材料	¥500

(4) 大判プリンター (Digital Factory)

区分	材料費等 (円/枚)
A2プリンターインク	¥100
B0プリンターインク	¥1,000

(8) レーザースキャナ (Digital Factory)

区分	材料費等 (1プロジェクト)
使用回数	¥5,000

事前講習、技術補助

区分	本学以外の機関に所属するもの	
	料金 (円)	(単位)
事前講習	10,000	/回
技術補助	10,000	/回

オープンファシリティセンター 表面解析ユニット 登録設備一覧

ユニット 内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
1	ダイヤモンドワイヤーソー (DWS3500)	メイワフォーシス (株)	DWS3500	青木隆史	https://surface-unit.coaf.kit.ac.jp/contact/		16号館	3	307号室	1,100 /時間
2	オスミウムコーター (Tenannt20)	メイワフォーシス (株)	Tenannt20	青木隆史			16号館	3	307号室	1,000 /時間
3	プラズマエッチング装置 (SEDE-PHL)	メイワフォーシス (株)	SEDE-PHL	青木隆史			16号館	3	307号室	900 /時間
4	マルチエリプソメーター (FS-4)	メイワフォーシス (株)	FS-4	青木隆史			16号館	3	307号室	1,400 /時間
5	マイクロカッティングマシン (BS-300CP)	メイワフォーシス (株)	BS-300CP	青木隆史			16号館	3	307号室	1,500 /時間
6	高速ダイヤモンドホイールソー (T205)	メイワフォーシス (株)	T205	青木隆史			16号館	3	307号室	800 /時間
7	卓上小型接触角計 (P60-A)	メイワフォーシス (株)	P60-A	青木隆史			16号館	3	307号室	800 /時間
8	デジタルマイクロスコープ	メイワフォーシス (株)	VHX-5000	青木隆史			16号館	3	307号室	800 /時間

オープンファシリティセンター 繊維ユニット 登録設備一覧

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
1	小型卓上試験機	島津製作所	EZ-LX 500N	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	4021室	1,000 /時間
2	染色物摩擦堅牢度試験機	大栄科学精器製作所	RT-300	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	4021室	1,000 /時間
3	高分解能型クリープメータ	山電	RE2-33005C	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	4021室	1,000 /時間
4	接触角計	協和界面科学	DMS-301	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	4021室	3,000 /時間
5	粒子径分布測定装置	島津製作所	SALD-2300	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	4021室	1,000 /時間
6	接触冷感測定装置	Profid	Thermofeel PF-QMM-01	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	4021室	1,000 /時間
7	変角分光測色機	村上色彩技術研究所	GCMS-4	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	4021室	7,000 /時間
8	立体編成型横編機	島精機製作所	SWG091N 10 ゲージ	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	4021室	1,500 /時間
9	3Dデザインシステム (CAD)	島精機製作所	SDS-ONE APEX3 または APEX4	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	4021室	1,500 /時間
10	環境制御型力学試験機	島津製作所	Autograph AG-X plus	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	2,000 /時間
11	ヤマト科学電気炉	ヤマト科学	F0811	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	1,500 /時間
12	粉碎機	フリッチュ	遊星型ボールミル P-7クラシックライン	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	1,000 /時間
13	小型溶融紡糸装置A			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	2,000 /時間
14	小型溶融紡糸装置B			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	2,000 /時間
15	巻取り機A			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	1,500 /時間
16	繊維延伸装置+巻き取り機			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	4,000 /時間
17	乾式紡糸装置			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	4,000 /時間
18	芯鞘型複合紡糸装置			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	13,000 /時間

オープンファシリティセンター 繊維ユニット 登録設備一覧

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
19	小型二軸混練押出機 (ラボプラ ストミル)	東洋精機製作所	2D15W	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	4,000 /時間
20	フィルム引取機	東洋精機製作所	FT2B8	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	1,000 /時間
21	一軸混練押出機			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	2,000 /時間
22	小型ベレタイザー	東洋精機製作所	MPETC1	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	1,000 /時間
23	卓上手動式射出成型機 (ハンド トゥルータ)	東洋精機製作所		繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	1,000 /時間
24	ゴム用混練機	入江商会	卓上型ニーダー PBV-1	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	2,000 /時間
25	湿式紡糸用凝固槽			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	1,000 /時間
26	フィルム二軸延伸機	井元製作所	IMC-190C型 11A9	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	5,000 /時間
27	小角X線散乱装置	リガク	NANO-Viewer	綿岡 勲	綿岡 勲	wataoka@kit.ac.jp	14号館	1階	S101室	10,900 /時間
28	透過型広角X線回折装置	リガク	Geigerflex RAD-II	綿岡 勲	綿岡 勲	wataoka@kit.ac.jp	14号館	1階	S101室	1,800 /時間